JP-A-2002-343573 Page 1 of 19

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-343573

(43) Date of publication of application: 29.11.2002

(51)Int.Cl.

H05B 33/22 H05B 33/10 H05B 33/14

(22)Date of filing:

(21)Application number: 2002-132910

08.05.2002

(71)Applicant: EASTMAN KODAK CO

(72)Inventor: RAYCHAUDHURI PRANAB

KUMAR

MADATHIL JOSEPH KURU

(30)Priority

Priority number: 2001 852956

Priority date: 10.05.2001

Priority country: US

(54) ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic light-emitting diode device that has a high displaying contrast.

SOLUTION: This is an organic light-emitting diode device having a high contrast that comprises (a) a transparent substrate, (b) an anode made of a transparent conductive material that is provided on the substrate, (c) an luminous layer containing an electroluminescent material that is provided on the anode, (d) a low-absorption ultra-thin electron injected layer that is provided on the luminous layer, (e) an intermediate layer containing a semimetal, metal, alloy or an intermetallic compound that is provided on the lowabsorption ultra- thin electron injected layer, and (f) a reflective material layer that is provided on the intermediate layer, and (g) has chosen the thickness of the intermediate layer in such a manner as to make the contrast high.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27 04 2005

[Date of sending the examiner's decision of

JP-A-2002-343573 Page 2 of 19

### rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### CLAIMS

# [Claim(s)]

[Claim 1] (a) A transparence substrate and (b) The anode made with the transparent conductive ingredient prepared on this substrate, (c) The luminous layer containing the electroluminescence ingredient prepared on this anode, (d) The low absorptivity ultra-thin electronic injection layer formed on this luminous layer, and (e) With the interlayer containing the semimetal and the metal which were prepared on this low absorptivity ultra-thin electronic injection layer, an alloy, or an intermetallic compound (f) It changes including the reflexibility ingredient layer prepared on this interlayer, and is (g). Organic high light emitting diode device of the contrast characterized by selecting this interlayer's thickness so that contrast may become high.

[Claim 2] (a) A transparence substrate and (b) The anode made with the transparent conductive ingredient prepared on this substrate, (c) The hole injection layer and electron hole transporting bed which were prepared on this anode, and (d) The luminous layer containing

Page 3 of 19 JP-A-2002-343573

the electroluminescence ingredient prepared on this electron hole transporting bed, (e) The electron transport layer prepared on this luminous layer, and (f) The low absorptivity ultra-thin electronic injection layer formed on this electron transport layer, (g) With the interlayer containing the semimetal and the metal which were prepared on this low absorptivity ultra-thin electronic injection layer, an alloy, or an intermetallic compound (h) It changes including the reflexibility ingredient layer prepared on this interlayer, and is (i). Organic high light emitting diode device of the contrast characterized by selecting this interlayer's thickness so that contrast may become high.

(Claim 3) (a) A transparence substrate and (b) The anode made with the transparent conductive ingredient prepared on this substrate. (c) The hole injection layer and electron hole transporting bed which were prepared on this anode, and (d) The luminous layer containing the electroluminescence ingredient prepared on this electron hole transporting bed, (e) The electron transport layer prepared on this luminous layer, and (f) With the interlayer containing the semimetal and the metal which were prepared on this electron transport layer, an alloy, or an intermetallic compound (g) It changes including the reflexibility ingredient layer prepared on this interlayer, and is (h). The electron injectional dopant which fully moves in order to offer electron injection relation between this reflexibility ingredient layer and this luminous layer is doped in this reflexibility ingredient layer. And the organic high light emitting diode device of the contrast characterized by selecting this interlayer's thickness so that contrast may become high.

[Claim 4] (a) The process which offers the reflecting layer which kept a transparence substrate and spacing and was put in order, (b) The process and (c) which prepare the anode made with the transparent conductive ingredient on this substrate The process and (d) which prepare the luminous layer containing an electroluminescence ingredient on this anode Between this reflecting layer and this luminous layer It is (e) to the process and list which prepare the interlayer containing semimetal, a metal, an alloy, or an intermetallic compound. By making an ultra-thin electronic injection layer deposit between this interlayer and this luminous layer Or by offering the dopant containing the alkali metal or alkaline earth metal which fully moves in order to offer electron injection relation between this reflecting layer and this luminous layer in this reflecting layer The manufacture approach of the organic high light emitting diode device of the contrast characterized by changing including the process which offers the electron injection nature to this luminous laver.

[Translation done.]

\* NOTICES \*

IP-A-2002-343573 Page 4 of 19

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- In the drawings, any words are not translated.

#### DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the manufacture approach of the organic high light emitting diode device of contrast, and such a device.

[0002]

[Description of the Prior Art] Although the organic electroluminescence (OEL) device is known also as an organic light emitting diode (OLED) device, it is useful in a flat panel form display application. When it can design so that the high red, green, and blue of brightness effectiveness may be obtained, driver voltage has the charm of this luminescence equipment in about 2-3 volts and a point low observable from a slanting include angle. Such a unique attribute originates in the basic OLED structure which considers as a configuration the multilayer stack which put the thin film of a low-molecular organic material between the hole injection layer and the electronic injection layer. Such structure is indicated by Tang's and others U.S. Pat. No. 4,769,292 and 4,885,211. The most common electroluminescence (EL) medium considers the two-layer structure of the electron hole transporting bed (HTL) which generally has the thickness of 20 - 30 nm extent, respectively, and a luminescence/electron transport layer (EML/ETL) as a configuration. An anode, i.e., the electrode for hole injections, is usually translucency indium stannic acid ghost (ITO) glass, and it works also as a substrate of OLED. The low metal layer of a work function is selected by the cathode of the device concerned, i.e., an electronic notes necessary electrode. The device concerned emits the light according to the potential difference impressed by carrying out the diameter of the EL medium. This light is emitted towards all directions. Among those, it is reflected and the part which hit the cathode front face is turned in the direction of an anode. For this reason, the luminous intensity which passes ITO glass increases. Thus, since the brightness of luminescence is promoted, a cathode with high reflective power is desirable. However, a high reflexibility cathode carries out the considerable-amount echo of the ambient light by which close comes to the device concerned through ITO glass simultaneously. When lighting level is high, the reflected ambient light may overwhelm EL luminescence and it may seem that luminescence is IP-A-2002-343573 Page 5 of 19

falling seemingly. Luminescence fades in an observer and it is visible to him. How for it to be visible the more, the more surrounding lighting becomes bright fades further, and the contrast on vision falls. In many applications, it is especially common in the outdoors or the bright interior of a room of lighting for the contrast on vision to be more important than luminescence reinforcement. In many applications, it is required that a display can be easily seen but I a little ] under [ various / with the sunlight from a pitch-black situation to / various / a dazzling situation I ambient conditions. One of the approaches of raising visual contrast is the approach of suppressing the echo from a cathode.

[0003] The approach of using a polarizer, especially a circular polarization of light child at the outside surface of a transparence substrate is one of those [ \*\*\*\* / things / as an approach ] which stop a glare. However, this approach will need the joint process of the addition which does not suit an OLED manufacture process, and will cause the increase of considerable cost. Furthermore, a polarizer will reduce luminescence reinforcement remarkably.

[0004] According to the option which Luxell Technologies (Journal of Military and Aerospace Electronics, Vol.9, No.6, and June 1998) indicated, the inorganic luminescence (EL) display on which the glare was stopped and the ease of reading under sunlight has been improved is obtained. The interference structure optically adjusted between back plates and phosphorescence ingredients with the gloss of EL stack is put. This interference structure is named "the daylight \*\*\*\*\*\*\* black layer (sunshine legible black layer)", and consists of the vacuum evaporationo layer of an absorptivity dielectric. The display of 14% of reflection factors was obtained by this technique.

[0005] There is an option which prepares and uses n mold oxygen-deficiency semi-conductor layer of ZnO 1-x on an ultra-thin LiF/aluminum bilayer form cathode as an interference adjustment layer. The structures of the device concerned are ITO/NPB/Alg/LiF/aluminum/85nm ZnO1-x/aluminum. This device is also substantially pressed down for reflective power from the standard device.

[0006] A reflex-inhibition ingredient must make thickness of an interference adjustment layer the thing of 100 nm extent in many cases, in order to stop reflective power as much as possible. In order to manufacture the such type structure, vacuum evaporationo time amount must be extended inevitably. Moreover, in order to prepare so that the optical property can reproduce an interference adjustment layer and it can predict, it is also clear that the vacuum evaporationo variable of these types of ingredient must be controlled strictly. Furthermore, these devices may lack in the stability over a long period of time potentially. Thermodynamic data have suggested possibility that aluminum will return ZnO 1-x. aluminum 2O3 which is easy to form by the ZnO1-x/aluminum interface concerned may worsen the operating voltage of a device. No data about the stability of these devices are reported. [0007] Renault et al (O.Renault, O.V.Salata, M.M.Chells, P.J.Dobson, V.Christou [Thin Solid

Page 6 of 19 IP-A-2002-343573

Films 379 (2000) 195-198l) has indicated the low reflective power multilayer cathode in which a chance that the contrast of OLED will be improved is shown. The structure of the device concerned includes a light absorption carbon thin film between a translucent electron injection Mg thin layer and aluminum upper layer. The reflection factor of a low reflective power cathode was 58% in 550 nm. The reflection factor which the standard cathode which consists of aluminum:Mg (10:1) shows was -100% in 550 nm. There was almost no difference in the current and the voltage characteristic of these two sorts of devices. Contrast is influenced by luminescence reinforcement and perimeter lighting, although it is required to reduce reflective power in order to improve contrast. EL values on the strength in 22V to which the standard device and the low reflective power device are reported are 130 cd/m2 and 68 cd/m2, respectively. When the reflective power value and brightness value which are reported are used according to the definition of their contrast, buildup of the contrast which exceeds the contrast of a standard device from the low reflective power device concerned must have been expected at all.

### 180001

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Therefore, the object of this invention is by having suppressed the echo from a reflecting layer to offer the new OLED device which raised the contrast of a display. By having suppressed the echo from a reflecting layer, another object of this invention is the advanced OLED device which raised the contrast of a display, and is to offer what employed the interlayer as the device structure concerned.

[0009] By having suppressed the echo from a reflecting layer, another object of this invention is the advanced OLED device which raised the contrast of a display, and is to offer what adopted semimetal, a metal, intermetallic compounds, or these alloys as the interlayer ingredient concerned. By having suppressed the echo from a reflecting layer, another object of this invention is the advanced OLED device which raised the contrast of a display, and is for the interlayer concerned to offer a very thin thing.

## [0010]

[Means for Solving the Problem] The above-mentioned object is (a). A transparence substrate and (b) The anode made with the transparent conductive ingredient prepared on this substrate, (c) The luminous layer containing the electroluminescence ingredient prepared on this anode,

- (d) The low absorptivity ultra-thin electronic injection layer formed on this luminous layer, and
- (e) With the interlayer containing the semimetal and the metal which were prepared on this low absorptivity ultra-thin electronic injection layer, an alloy, or an intermetallic compound (f) It changes including the reflexibility ingredient layer prepared on this interlayer, and is (g). It is attained by the organic high light emitting diode (OLED) device of the contrast characterized by selecting this interlayer's thickness so that contrast may become high.

[0011] The further above-mentioned object is (a). A transparence substrate and (b) The anode

Page 7 of 19 JP-A-2002-343573

made with the transparent conductive ingredient prepared on this substrate, (c) The luminous layer containing the electroluminescence ingredient prepared on this anode, (d) With the interlayer containing the semimetal and the metal which were prepared on this luminous layer, an alloy, or an intermetallic compound (e) It changes including the reflexibility ingredient layer prepared on this interlayer, and is (f). The electron injectional dopant which fully moves in order to offer electron injection relation between this reflexibility ingredient layer and this luminous layer is doped in this reflexibility ingredient layer. And it is attained by the high OLED device of the contrast characterized by selecting this interlayer's thickness so that contrast may become high.

[0012]

[Embodiment of the Invention] In the following explanation, in order to show the various layer names and operating characteristic of an organic light emitting diode device, an acronym is used. An acronym is listed to a table 1 for reference.

A table 1]		
×		

[0013] Drawing 1 is referred to here. The OLED device 100 by this invention changes including the transparence substrate 101, the transparence anode 102, a hole injection layer (HIL) 103, the electron hole transporting bed (HTL) 104, a luminous layer (EML) 105, an electron transport layer (ETL) 106, an interlayer (IL) 108, and reflecting layer 109a or 109b. As for an interlayer 108, it is desirable that the semi-conductor metal prepared on the low absorptivity ultra-thin electronic injection layer, a metal, an alloy, or an intermetallic compound is included. This interlayer's thickness is selected so that contrast may become high. In the mode of drawing 1 (a), the electronic injection layer 107 (a cathode layer is called hereafter) is formed on the ETL layer. In the mode of drawing 1 (b), the electron injection element which is spread in reflecting layer 109b to the front face of ETL, and pours an electron into it is contained. About the mode of drawing 1 (a), it was specified that it is desirable that within the limits of 0.2 - 10 nm has ultra-thin thickness as for the cathode layer concerned. On the occasion of

JP-A-2002-343573 Page 8 of 19

actuation, the reflecting layer and anode which are electrically connected to the cathode layer are connected to a power source 110 with a conductor 111, and an OLED device produces luminescence, i.e., electroluminescence, by passing a current to these organic layers. This electroluminescence is observable from a substrate side. Depending on the amount of currents which passes through the inside of the OLED device 100 as a result, it will depend for the reinforcement of electroluminescence on the charge impregnation property of a contact electrode at the brightness and the electrical property of the organic layer concerned, and a list.

[0014] Hereafter, the presentation and function of various layers which constitute an OLED device are explained. A substrate 101 can contain glass, a ceramic, or plastics. Since an elevated-temperature process is not needed for manufacture of an OLED device, if the processing temperature of about 100 degrees C can be borne, with any substrates, it becomes useful and almost all heat-resistant plastics is included by this. As a gestalt of a substrate, a hard plate, a flexibility sheet object, or a curvilinear solid is possible. The base material possessing the electronic back plane containing an electronic address switch component, for example, active mold substrate \*\*, may be included by the substrate 101. As an example of such an active mold substrate, a substrate with an elevated-temperature polish recon thin film transistor, a substrate with a low-temperature polish recon thin film transistor, a substrate with an amorphous silicon transistor, or the substrate with a thin film transistor of arbitration is mentioned. If it is this contractor, it can recognize about the object for the addresses of an OLED device, and other circuit elements for actuation.

[0015] An anode 102 offers the function to inject an electron hole into the organic layer concerned, when forward potential is impressed to OLED by relation with a cathode laver. For example, forming in U.S. Pat. No. 4,720,432 the anode in which the indium stannic acid chost (ITO) was excellent since the work function was comparatively high is shown. Since the ITO thin film itself is transparent. ITO coat glass serves as a base material which was excellent for manufacture of an OLED device. As other suitable anode ingredients, the thin film of alloy \*\* of the high metal of a work function, for example, Au(s), Pt(s), and Pd, and these metals is mentioned.

[0016] A hole injection layer (HIL) 103 offers the function which raises the hole-injection effectiveness from an anode to an organic layer. For example, the compound of a PORUFORIN system or a phthalocyanine system is useful as a hole injection layer to U.S. Pat. No. 4,885,211, and it is indicated that brightness effectiveness and stability of operation improve. CFx (0< x<=2) which is the fluorination polymer vapor-deposited with plasma vacuum deposition as other suitable HIL ingredients is mentioned. About the method of preparation and the property of CFx, it is indicated by the United States patent application 09th of Hung and others common to an assignee / No. 186,538 [the name "the organic electroluminescence

JP-A-2002-343573 Page 9 of 19

device (Organic Electroluminescent Device With a Non-Conductive Fluorocarbon Polymer) containing a non-conductive fluorocarbon system polymer\* of filing-date-of-application 11 month 5 day; invention), and the disclosure matter concerned is used as some of these descriptions.

[0017] The electron hole transporting bed (HTL) 104 offers the function to convey an electron hole to a luminous layer (EML) 105. Various kinds of aromatic amines which are indicated by U.S. Pat. No. 4,720,432 common to an assignee are contained in an HTL ingredient. The tetraarylamines of a bottom type (I) are mentioned as an HTL ingredient of a suitable class. [0018]

[Formula 1]



[0019] Ar. Ar1. Ar2. and Ar3 are respectively chosen from a phenyl part, a biphenyl part, and a naphthyl part independently among a top type, L is a divalent naphthalene part or dn. d is a phenylene part, and n is the integer of 1-4, and at least one of Ar, Ar1, Ar2, and the Ar3 is a naphthyl part.

[0020] The example of useful selected aromatic series (fused aromatic ring is contained) tertiary amine is as follows.

4 and 4'-screw [N- A (1-naphthyl)-N-phenylamino] biphenyl 4 4"-screw [N- (NPB) (1-naphthyl)-N-phenylaminol-p-terphenyl 4 and - bis[N-(2-naphthyl)-N-phenylaminol biphenyl 1 and 4 '5-bis [N-(1-naphthyl)-N-phenylamino] naphthalene 4 and 4'-screw [N- The (2-pvrenvl)-Nphenylamino] biphenyl 4, the - bis[N-(2-peri RENIRU)-N-phenylamino] biphenyl 2, 6-bis(G ptolylamino) naphthalene 2, 4' bis[ 6-] [G (1-naphthyl) amino] naphthalene [0021] Drawing 1 (a) and the luminous layer 105 of (b) offer the function which emits light as a result which an electron hole and an electron recombine within this layer. The suitable embodiment of a luminous layer dopes one or more sorts of fluorochromes into a host ingredient. If this hostdopant presentation is adopted, an efficient OLED device can be built. In reflecting laver 109b. in order to offer electron injection relation between reflecting layer 109b and a luminous layer 105, the electron injectional dopant which fully moves must be doped. This interlayer's thickness is selected so that contrast may become high. Although to dope to reflecting laver 109a is not required, either, it is possible. It can adjust by using simultaneously two or more fluorochromes from which luminescence wavelength differs the color of EL device in a common host ingredient. The dopant plan for the OLED device which uses Alq for Tang's and

JP-A-2002-343573 Page 10 of 19

others U.S. Pat. No. 4,769,292 common to an assignee as a host ingredient is considerably indicated by the detail. A luminous layer can contain the ingredient doped [ green luminescence ], the ingredient doped [ blue luminescence ], or the ingredient doped [ red luminescence ] as indicated by Tang's and others U.S. Pat. No. 4,769,292.

[0022] A group of eight-quinolinol metal chelate compound is contained in a suitable host ingredient. The chelation metals in that case are aluminum, Mg, Li, and Zn. As another group of a suitable host ingredient, 9 which is indicated by Shi's and others U.S. Pat. No. 5,935,721, 10-dinaphthyl anthracene, 9, 10-JIAN tolyl anthracene and the alkylation mold 9, and an anthracene derivative like 10-dinaphthyl anthracene are mentioned.

[0023] The coloring matter of fluorescence and phosphorescence and most pigments are included by the dopant ingredient. A dicyanomethylene pyran like the coumarins like the coumarin 6 which is indicated by Tang's and others U.S. Pat. No. 4,769,292 and Chen's and others U.S. Pat. No. 6,020,078 as a suitable dopant ingredient, and 4-dicyanomethylene-4H pyran etc. is mentioned.

[0024] The electron transport layer 106 of <u>drawing 1</u> (a) offers the function to convey the electron poured in from the cathode layer 107 to a luminous layer 105. As a useful ingredient, Alq and bends azole which are indicated by Shi's and others U.S. Pat. No. 5,645,948 are mentioned.

[0025] The cathode layer 107 of <u>drawing 1</u> (a) contains an electron injectional bilayer form element like LiF/aluminum. Moreover, low work function alloy [C. like a monolayer-like low work function metal or Mg:Ag What doped Li can raise the electronic injection efficiency to an ETL layer to the front face of W.Tang and S.A.VanSlyke, Appl.Phys.Lett.51, 913] (1987), or an electron transport layer [Junji Kido and Toshio Matsumoto, Appl.Phys.Lett.73, and 2866 (1998)]. The work function of the cathode layer 107 (refer to <u>drawing 1</u> a) is within the limits of 2-4 volts. In order to interact with an interlayer 108 optically, the cathode layer should be made the desirable thing which has high light transmittance.

[0026] An interlayer 108 contains semimetal, a metal, intermetallic compounds or those alloys, for example, germanium, Se, and Te, GeTe, W and Mo, or the conductive translucent layer of Ta\*\*. The thickness which minimum-ization of reflective power takes is usually thin, and this becomes useful on manufacture.

[0027] Reflecting layer 109a of drawing 1 (a) and reflecting layer 109b of drawing 1 (b) are high reflexibility, and it is desirable that it is conductivity. The alloy which contains one or more sorts of these metals in a metal list like Ag, aluminum, Au, and Cu as a principal component is contained in these. Reflecting layer 109b of drawing 1 (b) must contain further an electron injectional dopant from which the electronic notes incoming connection to an ETL layer is obtained. Although it is desirable that alkali metal or an alkaline earth metal is included as for such a dopant metal, it should have the ingredient in within the limits whose work function is 2-

JP-A-2002-343573 Page 11 of 19

4 volts anyway.

[0028] Although it is thought that drawing 1 (a) and the mode of (b) are suitable, if it is this contractor, it can recognize that the device which does not use a hole injection layer 103, the electron hole transporting bed 104, and an electron transport layer 106 can also be manufactured. If it is this contractor, it can recognize that a luminous layer can be selected so that an electron hole transport function and an electronic transport function may be included. and that an anode layer may function as a hole injection layer. In such a case, although a device requires a luminous layer 105, layers 103, 104, and 106 are not needed. [0029]

[Example] In the following examples, a table 1 should be referred to about the suitable function of the layer corresponding to the listed acronym. The layer which constitutes OLED on it was deposited on the substrate using ITO coat glass. The structure, the thickness, and the engine performance of the device concerned are shown in a table 2 - a table 5. HTL and EML/ETL were vapor-deposited by one reduced pressure operation using the vacuum coating machine. Subsequently, these samples were moved to the Plasmatron multifunctional mold vacuum evaporationo system (it has the engine performance with which a spatter list is coated by resistance and the e-beam heating method, without interrupting a vacuum), and all the layers that remain there were vapor-deposited. Finally, airtight enclosure of the device was carried out in the glove compartment filled up with desiccation nitrogen. Photo Research PR 650 spectrophotometer was used for the brightness of a device, and it measured it as a function of a current. The brightness L of the device shown in tables 2-5 (cd/m2) puts the value when passing the current equivalent to 20 mA/cm2 to a device, and V (bolt) is the driver voltage after compensating the voltage drop by the ITO resistance under these conditions. The reflection factor of a device was measured through the substrate using Filmetrics F 20 which is a thin film measuring device. The measuring device was proofread in advance of measurement, using a single crystal Si wafer as a preparation. The reflection factor shown in each table is a value in 525 nm near Alg luminescence wavelength.

100301 Contrast C is defined by this description as a ratio to the amount of effective luminescence at the time of concerned device un-operating I of the amount of effective luminescence at the time of the device actuation concerned 1, and is computed by the following formula.

Le is the device brightness in a pitch-black environment among a C=(Le+LaR)/LaR top type. and La is ambient-light reinforcement, and R is a device reflection factor. The contrast shown in tables 2-5 is a value in case ambient-light reinforcement is 80 cd/m2.

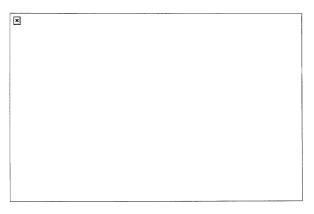
[0031] The structure, the thickness, and the engine performance of a device of the lot manufactured by one operation are shown in example 1 table 2. A device 10 is a standard device which has the LiF/aluminum bilaver form cathode which comes to carry out e-beam

Page 12 of 19 JP-A-2002-343573

vacuum evaporationo of the aluminum layer on the ultra-thin LiF film, germanium interlayer was prepared between the ultra-thin LiF/aluminum cathode and the reflecting layer in all the other devices 11-15. The vocabulary "an ultra-thin electronic injection layer" puts the thing of the electronic injection layer 107 (drawing 1 a) which has thickness within the limits of 0.2 - 10 nm. It is appropriate for this thickness that it is within the limits of 1-5nm, and it is desirable. An electronic injection layer 107 needs to be a low absorptivity layer, i.e., for a part of light to pass \*\*\*\*. It means that the vocabulary "low absorptivity" is 25% or more in the target wavelength permeability / of the electronic injection layer 107 concerned ]. The reflecting layer of these devices was taken as the heat evaporation layer of Ag. After a device reflection factor falls with the increment in germanium interlayer's thickness and reaches 12.6% of minimum values near 9.5 nm at the beginning, it rises with an interlayer's thickness, so that a table 2 and drawing 2 may show easily. In order that the middle class's thickness may reduce a device reflection factor and may raise contrast, it is selected within the limits of 3-30nm. However, as shown in drawing 3, it became clear that it is very desirable to make an interlayer's thickness into within the limits of 6-12nm when raising contrast. Furthermore in a table 2, the device for contrast and reflection factor lowering mold device (following and dark cathode device) should also care about that almost equivalent driver voltage's having been shown and the middle class concerned do not cause brightness lowering by devices other than the operation by decline in a device reflection factor. As shown in drawing 2, brightness follows the device reflection factor in general. This is because the amount contributed of a dark electrode to the whole brightness decreases. Furthermore, it should also care about that remarkable lifting of contrast is not necessarily what was attained by decline in a reflection factor. For example, although, as for the device 11 of a table 2, the lowering width of face of a reflection factor exceeds 20%, contrast lifting is only 30%. In the example shown in a table 2, in order to raise contrast twice [ about ], it is admitted that a reflection factor must be reduced farther than one half. [0032]

[A table 2]

JP-A-2002-343573 Page 13 of 19



[0033] The structure, the thickness, and the engine performance of a device of the lot manufactured by another operation are shown in example 2 table 3. In \*\*\*\*, the thickness of Alg was changed and the device with which driver voltages differ was manufactured. germanium interlayer of fixed thickness 10 nm was prepared between the ultra-thin LiF/aluminum cathode and the reflecting layer about all the devices 201-206. The spatter of the reflecting layer of a device was carried out from Ag target. It turns out easily that the reflection factor of the device concerned fell notably by the interlayer. Moreover, the reflection factor should also care about not being strongly influenced by the thickness of Alq. Although this must select an interlayer's thickness so that contrast may become the highest, it suggests that this method is effective in a low-battery actuation device and a high-tension actuation device. [0034]

[A table 3]

IP-A-2002-343573 Page 14 of 19



[0035] The structure, the thickness, and the engine performance of a device of another group which manufactured by the same operation are shown in example 3 table 4. The cathode of a standard device was made into the LiF/aluminum bilayer form, and the cathode of a high contrast device was made into the ultra-thin LiF/Y bilayer form. The reflecting layer of a device 302 considered as the e-beam evaporation mold aluminum layer, and, on the other hand, prepared the spatter mold Ag reflecting layer in the high contrast device 303. Although devices 302 and 303 had an organic layer and same germanium middle class, they showed a reflection factor with the device 303 containing Ag reflecting layer lower than the device 302 containing aluminum reflecting layer, and high contrast.

[0036]

[A table 4]

JP-A-2002-343573 Page 15 of 19

×	
0037] The structure, the thickness, and the engine performance of a device of and which manufactured by the same operation are shown in example 4 table 5. The che conventional device 401 was made into the LiF/aluminum bilayer form also her permanium interlayer's thickness was changed in a series of devices. However, the class deposited directly on ETL of devices 402-404. The cathode of these devices by carrying out the spatter of the silver alloy which does 4 mass % content of Li on Contrast became high while the device reflection factor fell by having prepared ger middle class, although it is because the driver voltage of these devices probably have comparatively low ********** injection efficiency and it became high rather than the driven a standard device.	athode of e again. e middle was formed ETL. manium

[0039] The advantage by a table 2 - a table 5 having included the thin interlayer in the OLED

JP-A-2002-343573 Page 16 of 19

structure is shown. Although it is almost changeless to driver voltage, as a result of a reflection factor's falling notably, contrast becomes high 3 times.

[0040]

[Effect of the Invention] The OLED device by this invention is advantageous in the point that contrast becomes high substantially, as compared with the device which has equivalent structure except for the middle class not being contained by suppressing the device echo of an ambient light notably. Moreover, the OLED device by this invention is advantageous also in the point of having a very thin conductive interlayer.

## [Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the schematic drawing showing the layer system of the various OLED device modes manufactured by this invention.

[<u>Drawing 2</u>] It is the graph which plotted brightness and a reflection factor to an interlayer's thickness.

[Drawing 3] It is the graph which plotted contrast to an interlayer's thickness.

[Description of Notations]

100 -- Organic light emitting diode (OLED) device

101 -- Transparence substrate

102 -- Transparence anode

103 -- Hole injection layer (HIL)

104 -- Electron hole transporting bed (HTL)

105 -- Luminous layer (EML)

106 -- Electron transport layer (ETL)

107 -- Electronic injection layer (EIL)

JP-A-2002-343573 Page 17 of 19

- 108 -- Interlayer
- 109 -- Reflecting layer
- 110 -- Power source
- 111 -- Conductor

# [Translation done.]

## \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## DRAWINGS

## [Drawing 1]

JP-A-2002-343573 Page 18 of 19

×	
Drawing 2]	
×	

[Drawing 2]		 	
×			

[Drawing 3]

Page 19 of 19 JP-A-2002-343573

[Translation done.]

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-343573 (P2002-343573A)

(43)公開日 平成14年11月29日(2002.11.29)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
H05B	33/22		H05B	33/22	A	3 K 0 0 7
	33/10			33/10		
	33/14			33/14	A	
	33/26			33/26	Z	

### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 10 頁)

		DE -M. 140-24	Manual Manual and Control
(21)出顯番号	特顧2002-132910(P2002-132910)	(71)出職人	590000846 イーストマン コダック カンパニー
(22)出顧日	平成14年5月8日(2002.5.8)		アメリカ合衆国, ニューヨーク14650, ロ チェスター, ステイト ストリート343
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	09/852956 平成13年5月10日(2001.5.10) 米国(US)	(72)発明者	プラナブ カマー レイチャウドハリ アメリカ合衆国, ニューヨーク 14612, ロチェスター, ジェイ ビー レーン 147
		(74)代理人	100077517 弁理士 石田 敬 (外4名)
			- Above

最終頁に続く

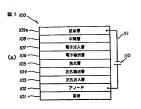
### (54) 【発明の名称】 有機発光ダイオードデバイス及びその製造方法

#### (57)【要約】

[課題] 表示コントラストの高い有機発光ダイオード デバイスの提供。

【解決手段】 (a) 透明基板と、(b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノードと、(c) 該アノード上に設けられた電場発光材料を含有する発光層と、

- (d) 該発光層上に設けられた低吸収性極薄電子注入層と、(e) 該低吸収性極薄電子注入層上に設けられた、半
- 金属、金属、合金又は金属間化合物を含む中間層と、
- (行) 数中間層上に設けられた反射性材料層とを含んで成 り、そして(g) 数中間層の厚さをコントラストが高くな るように選定した、ことを特徴とするコントラストの高 い有機発生ケイオードデバイス。
- 100 1096 反射魔 中間層 106 ~ 電子輸送層 (b) 105 ~ 発光層 104-正孔轴送槽 103-正孔法入居 111 アノード 102-主板 101 -



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 透明基板と、

(b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノ

1

- (c) 該アノード上に設けられた電場発光材料を含有する 発光層と、
- (d) 該発光層上に設けられた低吸収性極薄電子注入層 Ł,
- (e) 該低吸収性極薄電子注入層上に設けられた、半金
- 属、金属、合金又は金属間化合物を含む中間層と、
- (f) 該中間層上に設けられた反射性材料層とを含んで成 り、そして
- (の) 該中間層の厚さをコントラストが高くなるように選 定したことを特徴とするコントラストの高い有機発光ダ イオードデバイス。
- 【請求項2】 (a) 透明基板と.
- (b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノ ードと.
- (c) 該アノード上に設けられた正孔注入層及び正孔輸送
- (d) 該正孔輸送層上に設けられた電場発光材料を含有す る発光層と.
- (e) 該発光層上に設けられた電子輸送層と、
- (f) 該電子輸送層上に設けられた低吸収性極薄電子注入 層と.
- (a) 該低吸収性極薄電子注入層上に設けられた、半金 属、金属、合金又は金属間化合物を含む中間層と、
- (h) 該中間層上に設けられた反射性材料層とを含んで成
- り、そして
- (i) 該中間層の厚さをコントラストが高くなるように選 30 定したことを特徴とするコントラストの高い有機発光ダ イオードデバイス。
- 【請求項3】 (a) 透明基板と、
- (b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノ ードと.
- (c) 該アノード上に設けられた正孔注入層及び正孔輸送 層と.
- (d) 該正孔輸送層上に設けられた電場発光材料を含有す る発光層と、
- (e) 該発光層上に設けられた電子輸送層と、
- (f) 該電子輸送層上に設けられた、半金属、金属、合金 又は金属間化合物を含む中間層と、 (a) 該中間層上に設けられた反射性材料層とを含んで成
- り、そして (n) 該反射性材料層と該発光層との間に電子注入関係を
- 提供するために十分に移動する電子注入性ドーパントを 該反射性材料層にドープし、かつ、該中間層の厚さをコ ントラストが高くなるように選定したことを特徴とする コントラストの高い有機発光ダイオードデバイス。

た反射層を提供する工程。

- (b) 該基板上に、透明導電性材料でできたアノードを設 ける工程、
- (c) 該アノード上に、電場発光材料を含有する発光層を 設ける工程、
- (d) 該反射層と該発光層との間に、半金属、金属、合金 又は金属間化合物を含む中間層を設ける工程、並びに
- (e) 該中間層と該発光層との間に極薄電子注入層を堆積 させることにより、又は該反射層と該発光層との間に電 10 子注入関係を提供するために十分に移動するアルカリ金
  - 属もしくはアルカリ十類金属を含むドーパントを該反射 層内に提供することにより、該発光層への電子注入性を 提供する工程を含んで成ることを特徴とするコントラス トの高い有機発光ダイオードデバイスの製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コントラストの高 い有機発光ダイオードデバイスとそのようなデバイスの 製造方法とに関する。

20 [0002]

【従来の技術】有機電場発光(OEL)デバイスは、有機発 光ダイオード(OLED)デバイスとしても知られているが、 フラットパネル形ディスプレイ用途において有用であ ろ、この発光装置の魅力は、輝度効率の高い赤色、緑色 及び青色が得られるように設計することができる上、駆 動電圧が2~3ボルト程度と低く、また斜めの角度から 観察することもできる点にある。こうした特異な属性 は、低分子有機材料の薄膜を正孔注入層と電子注入層と の間に挟み込んだ多層スタックを構成とする基本OLED構 造に由来するものである。とのような構造は、Tangらの 米国特許第4,769,292号及び同第4,885,211号に開示され ている。最も一般的な電場発光(EL)媒体は、それぞれ一 般に20~30 nm程度の厚さを有する正孔輸送層(HTL)と発 光/電子輸送層(EML/ETL)との2層構造体を構成とす る。アノード、すなわち正孔注入用電極は、通常は透光 性インジウム錫酸化物(ITO)ガラスであって、OLEDの基 板としても働くものである。当該デバイスのカソード、 すなわち電子注入用電極には、仕事関数の低い金属層が 選定される。当該デバイスは、EL媒体を差し渡して印加 40 される電位差に応じて可視光を発する。この光はあらゆ る方向に向けて発せられる。そのうちカソード表面に当

このためITOガラスを通過する光の強度が増大する。 こ のように、発光の明るさを助長するので、反射能の高い カソードが好ましい。しかしながら、高反射性カソード は、同時に、ITOガラスを通して当該デバイスに入って くる周囲光を相当量反射する。照明レベルが高い場合、 反射された周囲光がEL発光を圧倒し、見掛け上発光が低 下しているように見えることがある。観察者には発光が

たった部分は反射されてアノードの方向に向けられる。

【請求項4】 (a)透明基板及び間隔を置いて並べられ 50 薄れて見える。周囲の照明が明るくなればなるほど見え

方は一層薄れ、視覚上のコントラストが低下する。多く の用途において、とりわけ屋外や昭明の明るい室内にお いては、発光強度よりも視覚上のコントラストが重要で あることが多い。多くの用途において、真っ暗な状況か ち太陽光が眩しい状況に至る各種周囲条件下でディスプ レイを幾分でも容易に見ることができることが要求され る。視覚的コントラストを高める方法の一つは、カソー ドからの反射を抑える方法である。

【0003】グレアを抑える方法として周知なものに、 透明基板の外表面に偏光子、特に円偏光子を使用する方 10 法がある。しかしながら、この方法はOLED製造プロセス に適合しない追加の結合工程を必要とし、相当なコスト 増を招くこととなる。 さらに、 偏光子は発光強度を著し く低下させてしまう。

[ 0 0 0 4 ] Luxell Technologies (Journal of Milita ry and Aerospace Electronics, Vol. 9, No. 6, June 1998)が開示した別の方法によると、グレアが抑えら れ、かつ、太陽光下での読み取り易さが改善された無機 発光(EL)ディスプレイが得られる。ELスタックの光沢の ある背面電極と燐光材料との間に、光学的に調整された 20 干渉構造体が挟み込まれている。この干渉構造体は、

「日光易読取性黒色層(sunshine legible black laye n」と名づけられており、吸収性誘電体の蒸着層から成 る。この技法により、反射率14%のディスプレイが得 らわた.

【0005】干渉調整層としてZnQ...。のn型酸素欠損半 導体層を極薄LiF/A1二層形カソードの上に設けて使用す る別の方法がある。当該デバイスの構造はITO/NPB/AIq/ LiF/A1/85nm ZnO... /A1である。このデバイスも、標準 デバイスより反射能が大幅に抑えられている。

【0006】反射抑制材料は、反射能を極力抑えるため には、干渉調整層の厚さを100 nm程度のものとしなけれ ばならないことが多い。このようなタイプの構造体を製 造するためには、必然的に蒸着時間を延長しなければな らない。また、干渉調整層をその光学特性が再現でき、 かつ、予測できるように調製するためには、これらのタ イブの材料の蒸着変数を厳密に制御しなければならない ことも明白である。さらには、これらのデバイスは、潜 存的に、長期間にわたる安定性に欠ける可能性もある。 熱力学的データは、AIがZnO<sub>t-x</sub>を還元する可能性を示唆 40 している。当該ZnO, 、/A1界面で形成し易いA1, O, がデバ イスの動作電圧を悪化させることもある。これらのデバ イスの安定性に関するデータは、一切報告されていな

[ 0 0 0 7 ] Renault et al (O. Renault, O.V. Salat a, M M, Chells, P.J. Dobson, V. Christou [Thin Sol id Films 379 (2000) 195-1981)は、OLEDのコントラス トが改良される見込みを示す低反射能多層カソードにつ いて記載している。当該デバイスの構造は、半透明電子 たものである。低反射能力ソードの反射率は550 nmで5 8%であった。AI:Mg(10:1)からなる標準カソードが示 す反射率は550 nmで~100%であった。これら2種の デバイスの電流・電圧特性にほとんど差はなかった。コ ントラストを改良するためには反射能を低下させること が必要であるが、コントラストは発光強度と周囲照明に も左右される。標準デバイスと低反射能デバイスについ て報告されている22VにおけるEL強度値は、それぞれ13 0 cd/m 及び68 cd/m である。彼らのコントラストの定 義に従い、かつ、報告されている反射能値及び輝度値を 用いた場合、当該低反射能デバイスからは、標準デバイ スのコントラストを上回るコントラストの増大は、まっ たく予期し得ない。

[0008]

[発明が解決しようとする課題] したがって、本発明の 目的は、反射層からの反射を抑えたことによりディスプ レイのコントラストを高めた新規OLEDデバイスを提供す ることにある。本発明の別の目的は、反射層からの反射 を抑えたことによりディスプレイのコントラストを高め た改良型OLFDデバイスであって、当該デバイス構造体に 中間層を採用したものを提供することにある。

【0009】本発明の別の目的は、反射層からの反射を 抑えたことによりディスプレイのコントラストを高めた 改良型OLEDデバイスであって、当該中間層材料として半 金属、金属もしくは金属間化合物又はこれらの合金を採 用したものを提供することにある。本発明の別の目的 は、反射層からの反射を抑えたことによりディスプレイ のコントラストを高めた改良型OLEDデバイスであって、 当該中間層が極めて薄いものを提供することにある。

30 [0010]

【課題を解決するための手段】上述の目的は、(a) 透明 基板と、(b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でで きたアノードと、(c) 該アノード上に設けられた電場発 光材料を含有する発光層と、(d) 該発光層上に設けられ た低吸収性極薄電子注入層と、(e) 該低吸収性極薄電子 注入層上に設けられた、半金属、金属、合金又は金属間 化合物を含む中間層と、(f) 該中間層上に設けられた反 射性材料層とを含んで成り、そして(g) 該中間層の厚さ をコントラストが高くなるように選定したことを特徴と するコントラストの高い有機発光ダイオード(OLED)デバ

イスによって達成される。 【0011】 さらに上述の目的は、(a) 透明基板と、 (b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノ ードと、(c) 該アノード上に設けられた電場発光材料を 含有する発光層と、(d) 該発光層上に設けられた、半金 属、金属、合金又は金属間化合物を含む中間層と、(e) 該中間層トに設けられた反射性材料層とを含んで成り、 そして(f) 該反射性材料層と該発光層との間に電子注入 関係を提供するために十分に移動する電子注入性ドーバ 注入Mc疎層とA7上層との間に吸光性カーボン薄膜を含め 50 ントを該反射性材料層にドープし、かつ、該中間層の厚 さをコントラストが高くなるように選定したことを特徴 とするコントラストの高いOLEDデバイスによって達成さ れる。

[0012]

[発明の実施の形態]以下の説明では、有機発光ダイオ\*

\* ードデバイスの各種層名称及び動作特性を示すために頭 字語を使用する。参照のため、頭字語を表1に列記す る。

【表1】

	表1
OLED	有機発光ダイオード
IT0	インジウム燐酸化物
HIL	正孔注入層
HTL	正孔輪送潛
EML.	発光層
ETL	電子輸送層
NPB	4, 4' ーピス [Nー(1ーナフチル)-Nーフェニルアミノ] ピフェニル (NPB)
Alq	トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム
Lif	フッ化リチウム
Al	アルミニウム
γ	イットリウム
Ge	ゲルマニウム
Ag	鍵

【0013】 ここで図1を参照する。本発明によるOLFD 20 デバイス100は、透明基板101と、透明アノード1 02と、正孔注入層(HIL)103と、正孔輸送層(HIL)1 04と、発光層 (EML) 105と、電子輸送層 (ETL) 106 と、中間層(TI)108と、反射層109a又は109b とを含んで成る。中間層108は、低吸収性極薄電子注 入層上に設けられた、半導体金属、金属、合金又は金属 間化合物を含むことが好ましい。該中間層の厚さはコン トラストが高くなるように選定されている。図1 (a) の態様では、ETL層の上に電子注入層107(以下、カ ソード層と称する) が設けられている。図1(b)の態 30 様では、反射層109hに、FTIの表面へ拡散して電子 を注入する電子注入要素が含まれる。 図1 (a) の態様 に関しては、当該カソード層は厚さが0.2~10 nmの範囲 内の極薄であることが好ましいことが特定された。動作 に際しては、カソード層に対して電気的に接続されてい る反射層とアノードを導体111により電源110に接 続し、これらの有機層に電流を流すことによりOLEDデバ イスが発光、すなわち電場発光を生じる。この電場発光 は基板側から観察することができる。電場発光の強度 は、OLEDデバイス100の中を通過する電流量に依存 し、ひいては当該有機層の輝度・電気特性、並びに接触 電極の電荷注入特性に依存することとなる。

[0014]以下、OLDデバイスを構成する名種層の組成及び機能とついて説明する。基板「01はガラス・セラミック又はガラスチックを含むことができる。OLEDデバイスの製造には高温プロセスは必要とされないので、100で程度の処理温度に耐えられるものであればどのような基板でも有用となり、これにはほとんどの耐熱性ブラスチックが包含される。基板の形態としては硬質板状体、柔軟性シート体又は曲面体が可能である。基板150

01 には、電子アドレス・スイッチ素子を含せ電子的パックプレインを具備した支持体、例えばアクティブ型基板の外として、高温ポリシリコン機関トランジスタ付き基板、低温ポリシリコン機関トランジスタ付き基板、不なルファスシリコントランジスタ付き基板、又は任策の機関トランジスタ付き基板が挙げられる。当業者であれば、QL ロデバイスのアドレス用及び駆動用の他の回路素子について経識するとができる。

【0015】アノード102は、カソード層との関係で 正常位をOEDXCIP加した時に当該有機層に正式を注入する機能を提供する、例えば、米国時幹第41,20,432号 は、比較的仕事関数が高いことからインジウム錦籠化が (TIO)が優れたアノードを形成することかが、ITO機関ガラス はOLEDデバイスの製造にとって優れた支持体となる。他 の好適なアノード材料として、仕事関数の高い金属、例 えば、Au. Pt. Pd又はこれらの金属の合金、の薄膜が挙 げられる。

【0016】正孔注入層(HII)103は、アノードから有機層への正孔注入効率を高める機能を提供する。例えば、米国特許第4,885,211号に、正孔注入層としてポルフォリン系又はてクロシアニン系の任合物が有用であり、輝度効率及び動作安定性が向上することが記載されている。他の好適な旧は材料として、ブラズマ蒸着法で蒸着されたファ素化ポリマーであるCF、(0く×≦2)が挙げられる。CF、の関数注及び特性については、譲受人共通のHung与の米国特許出願第09/186,538号(出願日11月5日:発明の名称「非導電性アルギロカーボン系ポリマーを含む有機電場発光デバイス(Organic Electroluminescent Device With a Non-Conductive Fluorocarbon

Polymer)」〕に開示されており、当該開示事項を本明細 書の一部とする。

【0017】正孔翰送層(HTL)104は、正孔を発光層 (EML) 105へ輸送する機能を提供する。HTL材料には、 譲受人共通の米国特許第4.720.432号に開示されている ような各種の芳香族アミンが含まれる。好適な種類のHT L材料として下式(I)のテトラアリールアミン類が挙げ **られる**。

[0018]

((£1)



【0019】上式中、Ar、Ar、Ar 及びAr は、各々独 立に、フェニル部分、ピフェニル部分及びナフチル部分 の中から選ばれ、1.は2価のナフタレン部分又は4.で あり、dはフェニレン部分であり、nは1~4の整数で あり、そしてAr、Ari、Ari 及びAri の少なくとも一つは ナフチル部分である。

[0020] 有用な選ばれた(縮合芳香環を含有する) 芳香族第3アミンの例は以下の通りである。

4.4 -ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ピフェ

ニル(NPB) 4,4" -ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]-p-ター

フェニル

4.4' -ビス [N-(2-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェ = 1b 1.5-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ナフタレ

4,4'-ビス[N-(2-ピレニル)-N-フェニルアミノ]ピフェ

ニル 4.4' -ビス[N-(2-ペリレニル)-N-フェニルアミノ]ビフ

2.6-ビス(ジ-p-トリルアミノ)ナフタレン

2.6-ビス「ジ-(1-ナフチル)アミノ]ナフタレン 【0021】図1(a)及び(b)の発光層105は、 この層内で正孔と電子が再結合する結果として光を発す る機能を提供する。発光層の好適な実施態様は、ホスト 材料に1種以上の蛍光色素をドープしたものである。と のホストードーバント組成を採用すると、高効率OLEDデ バイスを構築することができる。 反射層 109 b には、 反射層109bと発光層105との間に電子注入関係を 提供するために十分に移動する電子注入性ドーパントを ドープしなければならない。該中間層の厚さはコントラ ストが高くなるように選定される。反射層109aにド ービングを施すことも、必要ではないが可能である。同 50 含む合金が含まれる。図1 (b) の反射層109 bは、

時に、ELデバイスの色を、共通のホスト材料中に発光波 長の異なる複数の蛍光色素を使用することにより調整す ることができる。譲受人共通のTangらの米国特許第4,76 9.292号に、ホスト材料としてAlgを使用するOLEDデバイ スのためのドーバント計画がかなり詳細に記載されてい る。Tangらの米国特許第4,769,292号に記載されている ように、発光層は、緑色発光性被ドーブ材料、青色発光 性被ドーブ材料又は赤色発光性被ドーブ材料を含有する ことができる。

10 【0022】好適なホスト材料には8-キノリノール金属 キレート化合物の一群が含まれる。その際のキレート化 金属は、例えば、Al. Ma. Li. Znである。好適なホスト 材料の別の群として、Shiらの米国特許第5,935,721号に 開示されているような、9.10-ジナフチルアントラセ ン. 9.10-ジアントリルアントラセン及びアルキル置換 型9.10-ジナフチルアントラセンのようなアントラセン 誘導体が挙げられる。

【0023】ドーパント材料には、蛍光性及び燐光性の 色素及び顔料の大部分が包含される。好適なドーパント 材料として、Tang5の米国特許第4,769,292号及びChen ちの米国特許第6.020.078号に開示されているような、 クマリン6のようなクマリン類、4-ジシアノメチレン-4 Hビランのようなジシアノメチレンビラン、等が挙げら れる。

【0024】図1(a)の電子輸送層106は、カソー ド層107から注入された電子を発光層105へ輸送す る機能を提供する。有用な材料として、Shiらの米国特 許第5.645.948号に開示されているような、Ala及びベン ズアゾールが挙げられる。

【0025】図1(a)のカソード層107は、LiF/Al のような電子注入性二層形要素を含む。また、単層状の 低仕事関数金属もしくはMg:Agのような低仕事関数合金 [C.W.Tang and S.A. VanSlyke, Appl. Phys. Lett. 51, 913 (1987)]又は電子輸送層の表面にLiをドープしたも のも、FTI層への電子注入効率を高めることができる[Ju nii Kido and Toshio Matsumoto, Appl. Phys. Lett. 7 3. 2866(1998)1。カソード層107 (図1a参照)の仕 事関数は2~4ボルトの範囲内である。中間層108と 光学的に相互作用するため、カソード層は好ましくは光 40 透過率の高いものにすべきである。

[0026]中間層108は、半金属、金属、金属間化 合物又はそれらの合金、例えば、Ge、Se、Te、GeTe、 W、Mo又はTa、の導電性半透明層を含む。反射能の最低 化に要する層厚は通常薄く、このことが製造上有益とな る.

【0027】図1 (a)の反射層109a及び図1

(b)の反射層109bは、高反射性で且つ導電性であ ることが好ましい。これらには、Ag、A1、Au及びCuのよ うな金属並びにこれらの金属の1種以上を主成分として FIMEへの電子は入港飲が得られるような電子注入性ドーパントをさらに含有しなければならない。このようなドーパントをさらに含有しなければならない。このようなドーパント金属は、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含むことが呼ましいが、いずれにしても仕事関数が2~4ボルトの範囲外にある材料を有するべきである。と考えられるが、当業者であれば、正孔注入層103、正孔輸送層104及び電子輸送層10名を使用しないデバイスも製造できることを認識することができる。当業者であれば、発光層を、正孔輸送機能及び電子輸送機能10が含まれるように選定することができること。またアノード層が正孔上別をして機能得なことを邀請することができること。またアノード層が正孔上別をして機能得ることを邀請することができる。

#### [0029]

【実施例】以下の実施例では、列記した頭字語に対応す る層の適当な機能について表1を参照すべきである。基 板にはITO被覆ガラスを用い、その上にOLEDを構成する 層を堆積した。表2~表5 に、当該デバイスの構造。層 20 厚及び性能を示す。HTL及びEML/ETLは、真空コーターを 用いて1回の減圧運転で蒸着した。次いで、これらの試 料をPlasmatron多機能型蒸着システム(真空を中断する ことなくスパッタ法並びに抵抗及びe-ビーム加熱法によ りコーティングする性能を有する) に移し、そこで残る すべての層を蒸着した。最後に、乾燥窒素を充填したグ ローブボックス内でデバイスを気密封入した。デバイス の輝度は、Photo Research PR 650分光光度計を使用 し、電流の関数として測定した。表2~5に示したデバ イスの輝度L(cd/m²)は、20 mA/cm² に相当する電流をデ 30 パイスに流した時の値をさし、またV(ボルト)は、こ の条件下での、ITO抵抗による電圧降下を補償した後の 駆動電圧である。デバイスの反射率は、薄膜測定装置で あるFilmetrics F 20を使用して基板を通して測定し た。測定に先立ち、標品として単結晶Siウェハを用いて 測定装置を較正した。各表に示した反射率は、Ala発光 波長に近い525 nmにおける値である。

【0030】コントラストCは、本明細書では当該デバ イス動作時の実効発光量の当該デバイス非動作時の実効 発光量に対する比率として定義され、下記式で算出され 40

 $C = (L_+ + L_R) / L_R$ 

ト式中、 L. は真っ暗な環境におけるデバイス輝度であ

り、L。は周囲光強度であり、そしてRはデバイス反射率である。表2~5 において示したコントラストは、周囲光強度が80 cd/㎡ である場合の値である。

#### [0031149]1

表2に、1回の運転で製造した一組のデバイスの構造、 層厚及び性能を示す。デバイス10は、極薄LiF膜上にA 1層をe-ビーム蒸着してなるLiF/AT二層形カソードを有 する標準デバイスである。その他のデバイス11~15 のすべてに、極薄LiF/AIカソードと反射層との間にGe中 間層を設けた。用語「極薄電子注入層」とは、厚さが0. 2~10 nmの範囲内にある電子注入層107(図1a)の ことをさす。この厚さは1~5 nmの範囲内にあることが 適切で好ましい。電子注入層107は低吸収性層である こと、すなわち、光の一部が本層を通過することが必要 である。用語「低吸収性」とは、当該電子注入層107 の透過率が、対象となる波長において25%以上である ことを意味する。これらのデバイスの反射層はAcの熱蒸 発展とした。表2及び図2から容易にわかるように、デ バイス反射率は、当初はGe中間層の厚さの増加と共に低 下し、9.5 nm付近で最低値12.6%に達した後、中間層の 厚さと共に上昇する。中間層の厚さは、デバイス反射率 を低下させ、かつ、コントラストを高めるため、3~3 0 nmの範囲内に選定される。しかしながら、図3 に示し たように、中間層の厚さを6~12 nmの範囲内とするこ とが、コントラストを高める上で極めて望ましいことが 判明した。さらに表2において、対照用デバイスも、反 射率低下型デバイス(以下、暗カソードデバイス)も、 ほぼ同等の駆動電圧を示したとと、そして当該中間層 が、デバイス反射率の低下による作用以外の機構による 輝度低下の原因にはなっていないようであることにも留 意すべきである。 図2 に示したように、 輝度はデバイス 反射率に概ね追従している。これは、輝度全体に対する 暗電極の寄与分が減少するからである。さらには、コン トラストの顕著な上昇が、必ずしも反射率の低下によっ て達成されたものではないことにも留意すべきである。 例えば、表2のデバイス11は、反射率の低下幅が20 %を超えるが、コントラスト上昇は30%にすぎない。 表2に示した実施例では、コントラストを約2倍に高め るためには、反射率を1/2よりもはるかに低下させな ければならないことが認められる。

[0032]

【表2】

12

11

表2:中間層の厚さを変更したOLEDデバイスの構造、層厚及び性能											
ĩ' N' ÍZ ID	7/-ト゚ ITO 厚さ (nm)	HIL GFx 厚さ (nm)	HTL NPB 厚さ (nm)	ENL/ETL 原さ (nm)	カソード LiF/Ai 厚さ (nm)/(nm)	中間層 Ge 厚さ (nm)	反射体 金属 厚さ (nm)	駆動 電圧 (V)	輝度 (cd/sf²)	反射率 (%)	וגלוננ
10	42	1	75	60	0.5/1.0	0	A1 59	5. 7	504	68. 0	10
11	42	1	75	60	0. 5/1. 0	2. 5	Ag 50	5. 6	444	46. 0	13
12	42	1	75	60	0. 5/1. 0	5. 0	Ag 50	5. 7	371	28. 2	17
13	42	1	75	60	0.5/1.0	9. 5	Ag 50	8. 0	271	12. 6	28
14	42	1	75	60	0.5/1.0	17. 5	Ag 50	6. 1	245	17. 5	19
15	42	,	75	60	0. 5/1. 0	30. 0	<b>Ag</b> 50	6. 3	313	28. 0	15

### 【0033】例2

表3に、別の運転で製造した一組のデバイスの構造、層 厚及び性能を示す。本組ではAlgの厚さを変更し、駆動 電圧の異なるデバイスを製造した。デバイス201~2 06のすべてについて、極薄LiF/AIカソードと反射層と の間に、一定厚さ10 nmのGe中間層を設けた。デバイス の反射層はAgターゲットからスパッタした。当該デバイ スの反射率が中間層によって顕著に低下したことが容易\* \*にわかる。また、反射率がAlqの厚さによる影響を強く は受けていないことにも留意すべきである。このこと

は、中間層の厚さをコントラストが最高になるように選 定しなければならないが、本法が低電圧駆動デバイスに も高電圧駆動デバイスにも有効であることを暗示するも のである。

反射率 コントラスト

[0034] 【表3】

EML/ETL カソート 中間層 反射体 駆動

	厚さ (nm)	厚さ (nm)	呼さ (nm)	厚さ (nm)	厚さ (net)/(net)	厚さ (nm)	座さ (nat)	(V)	(00/m·)	Oil	
201	42	1	75	40	0. 5/1. 0	10	Ag 60	4.4	221	13. 8	21
202	42	1	75	50	0. 5/1. 0	10	Ag 60	4. 9	254	12. 8	26
203	42	1	75	60	0. 5/1. 0	10	Ag 60	5. 7	250	12. 0	27
204	42	1	75	70	0.5/1.0	10	Ag 60	6. 3	259	9. 7	34
205	42	1	75	80	0. 5/1. 0	10	Ag 60	7. 0	234	8. 2	37
206	42	1	75	90	0.5/1.0	10	Ag 60	7. 8	222	7. 6	38

表3:EML/ETLを変更したOLEDデバイスの構造、層厚及び性能

[0035]例3

層厚及び性能を示す。標準デバイスのカソードはLiF/A1 表4に、同一運転で製造した別の組のデバイスの構造、 50 二層形とし、高コントラストデバイスのカソードは極薄

14

13 LiF/Y二層形とした。デバイス302の反射層はe-ビー ム蒸発型AI層とし、一方、高コントラストデバイス30 3にはスパッタ型Ag反射層を設けた。デバイス302と 303は、有機層及びGe中間層が同一であるが、Ao反射

\*ス302よりも、低い反射率及び高いコントラストを示 Utc. [0036] 【表4】

層を含むデバイス303の方が、AI反射層を含むデバイ米

表 4 :標準デバイス及び高コントラストデバイスの構造、層厚及び性能													
デ パイス ID	7/-ド ITO 厚さ (rum)	HIL CFx 厚さ (nm)	HTL NPB 厚さ (rum)	EML/ETL Alq 厚さ (nm)	カソード 厚さ (nm)/(nm)	中間層 Ge 厚さ (nm)	反射体 金濃 厚さ (nm)	駆動 電圧 (V)	輝度 (cd/m²)	反射率 (%)	וגלוענ		
301	42	1	75	60	0.5/1	0	A1 60	6. 9	472	68. 0	10		
302	42	1	75	60	0.5/1.5	9. 5	A1 60	8. 9	327	29. 1	15		
303	42	1	75	60	0.5/1.5	9. 5	Ag 60	8. 6	221	11.0	26		

[0037]例4

表5 に、同一運転で製造した別の組のデバイスの構造、 層厚及び性能を示す。ここでもまた、従来のデバイス4 01のカソードはLiF/AI二層形とした。一連のデバイス においてGe中間層の厚さを変更した。しかしながら、中 間層は、デバイス402~404のETLの上に直接堆積 した。これらデバイスのカソードは、Liを4質量%含有

※た。これらデバイスの駆動電圧は、おそらくは電子注入 20 効率が比較的低いことが原因で、標準デバイスの駆動電

圧よりも高くなるものの、Ge中間層を設けたことによ り、デバイス反射率が低下すると共に、コントラストが 高くなった。

[0038]

【表5】

表5:標準デパイス及び高コントラストデパイスの構造、層厚及び性能													
7° ^ 17 ID	7/-ト* ITO 厚さ (nm)	HIL CFx 厚さ (rum)	HTL NPB 厚さ (nm)	EMIL/ETL Atq 厚さ (nm)	中間層 Ge 厚さ (nm)	かード/ 反射体 厚さ (nm)	枢動 電圧 (V)	輝度 (ad/m²)	反射率 (%)	コントラスト			
401	42	1	75	60	0.0	LiF 0.5/ AI 60	5. 4	517	69. 0	10			
402	42	1	75	60	5. 0	Ag:Li 60	6. 4	331	31. 0	14			
403	42	1	75	60	9. 5	Ag:Li 60	6. 3	252	14. 0	24			
404	42	1	75	60	15. 0	Ag:Li 60	6, 6	221	16. 0	18			

[0039]表2~表5は、OLED構造体に薄い中間層を 含めたことによる利点を示している。駆動電圧にほとん ど変化はないが、反射率が顕著に低下する結果、コント ラストが3倍高くなる。

#### [0040]

[発明の効果] 本発明によるOLEDデバイスは、中間層が 含まれていないことを除いて同等な構造を有するデバイ スと比較して、周囲光のデバイス反射が顕著に抑えられ 50 【図2】輝度と反射率を中間層の厚さに対してプロット

ることによりコントラストが実質的に高くなる点におい て有利である。また、本発明によるOLEDデバイスは、極 めて遠い邁電性中間層を有する点においても有利であ

#### 【図面の簡単な説明】

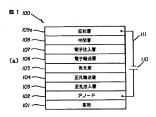
【図1】本発明により製造される各種OLEDデバイス態様 の層構造を示す略図である。

したグラフである。 \* 104…正孔輸送層(HTL) 【図3】コントラストを中間層の厚さに対してブロット したグラフである。 【符号の説明】 100…有機発光ダイオード(OLED)デバイス

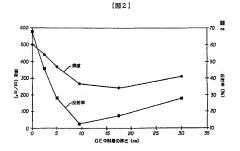
101…透明基板 102…透明アノード 103…正孔注入層(HIL) 105…発光層(EML) 106…電子輸送層(ETL) 107…電子注入層(EIL) 108…中間層 109…反射層

110…電源 111…導体

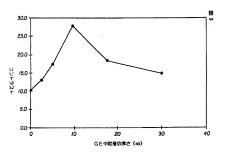
[図1]











### フロントページの続き

(72)発明者 ジョーゼフ クル マダシル アメリカ合衆国、ニューヨーク 14621、 ロチェスター、レスターシャー ロード 164

Fターム(参考) 3K007 AB17 CB01 CC01 DB03

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【公開番号】特開2002-343573(P2002-343573A)

【公開日】平成14年11月29日(2002.11.29)

【出願番号】特願2002-132910(P2002-132910)

【国際特許分類第7版】

H 0 5 B 33/22 H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14

H 0 5 B 33/26

[FI]

H 0 5 B 33/22 Α H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14

Α H 0 5 B 33/26 7.

### 【手続補正書】

【提出日】平成17年4月27日(2005.4.27)

【手続補正1】

[補下対象書類名] 明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 透明基板と、

- (b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノードと、
- (c) 該アノード上に設けられた電場発光材料を含有する発光層と、
- (d) 該発光層上に設けられた電子輸送層及び該電子輸送層上に設けられた低吸収性極薄 電子注入層と、
- (e) 該低吸収性極薄電子注入層上に設けられた、半金属、金属、合金又は金属間化合物 を含む中間層と、
- (f) 該中間層上に設けられた反射性材料層と

を含んで成り、そして

- (g) 該中間層の厚さを、該中間層を設けなかった場合の対応デバイスと比較してコント ラストが高くなるように選定した
- ことを特徴とするコントラストの高い有機発光ダイオードデバイス。

### 【請求項2】

- (a) 透明基板と、
- (b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノードと、
- (c) 該アノード上に設けられた正孔注入層及び正孔輸送層と、
- (d) 該正孔輸送層上に設けられた電場発光材料を含有する発光層と、
- (e) 該発光層上に設けられた電子輸送層と、
- (f) 該電子輸送層上に設けられた低吸収性極薄電子注入層と、
- (q) 該低吸収性極薄電子注入層上に設けられた、半金属、金属、合金又は金属間化合物 を含む中間層と、
  - (h) 該中間層上に設けられた反射性材料層と

を含んで成り、そして

- (i) 該中間層の厚さを<u>、該中間層を設けなかった場合の対応デバイスと比較して</u>コントラストが高くなるように選定した
- ことを特徴とするコントラストの高い有機発光ダイオードデバイス。

# 【請求項3】

- (a) 透明基板と、
- (b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノードと、
- (c) 該基板上に設けられた電場発光材料を含有する発光層と、
- (d) 該発光層上に設けられた、半金属、金属、合金又は金属間化合物を含む中間層と、
- (e) 該中間層上に設けられた反射性材料層と
- を含んで成り、そして
- (f) 該反射性材料層と該発光層との間に電子注入関係を提供するために十分に移動する電子注入性ドーパントを該反射性材料層にドーブし、かつ、該中間層の厚さを<u>該中間層を設けなかった場合の対応デバイスと比較して</u>コントラストが高くなるように選定したことを特徴とするコントラストの高い有機発光ダイオードデバイス。 【請求項4】

## (a) 透明基板と、

- (b) 該基板上に設けられた透明導電性材料でできたアノードと、
- (c) 該アノード上に設けられた正孔注入層及び正孔輸送層と、
- (d) 該正孔輸送層上に設けられた電場発光材料を含有する発光層と、
- (e) 該発光層上に設けられた電子輸送層と、
- (f) 該電子輸送層上に設けられた、半金属、金属、合金又は金属間化合物を含む中間層と、
- (g) 該中間層上に設けられた反射性材料層と を含んで成り、そして
- (h) 該反射性材料層と該発光層との間に電子注入関係を提供するために十分に移動する電子注入性ドーパントを該反射性材料層にドープし、かつ、該中間層の厚さを<u>該中間層を設けなかった場合の対応デパイスと比較して</u>コントラストが高くなるように選定したことを特徴とするコントラストの高い有機発光ダイオードデパイス。